

## 真空蒸着装置



真空蒸着装置  
アネルバ（株）  
VD-43N

平成5年度導入

**【主な用途・仕様】**

金属薄膜の成膜

- ・ 試料サイズ：φ 2 インチ程度
- ・ 蒸着方式：電子線加熱
- ・ 膜種：Au、Cr、Pt etc

**【担当部署】** 電子情報システム部：MEMS グループ

**【設備使用の項目・使用料】** 真空蒸着装置

**【受託試験の項目・手数料】** マイクロマシニング加工（B）